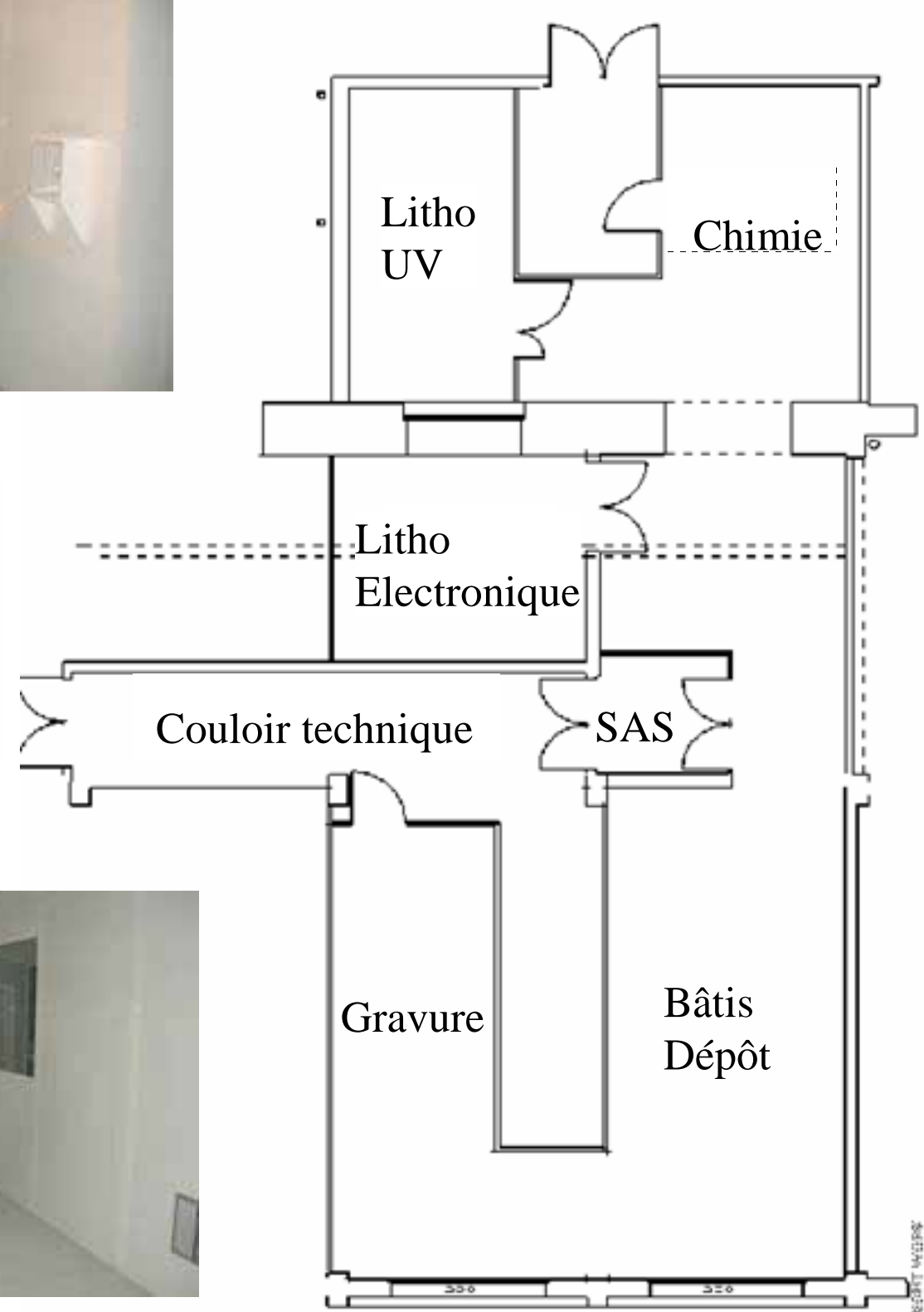
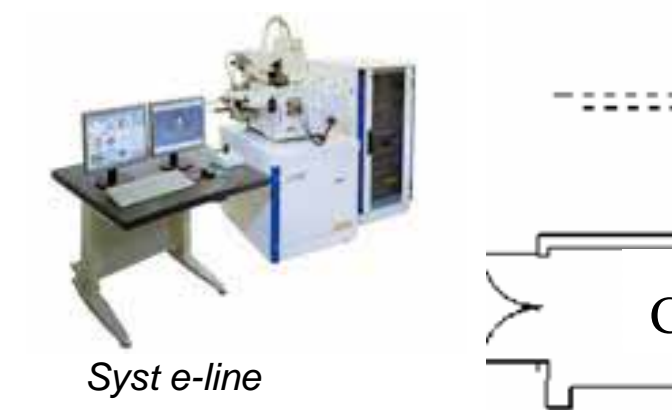
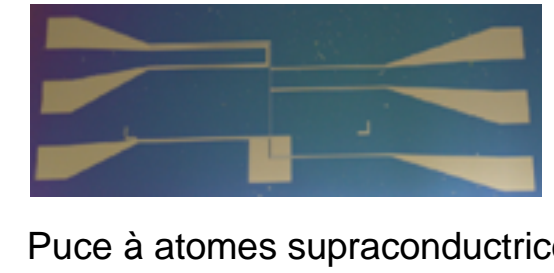


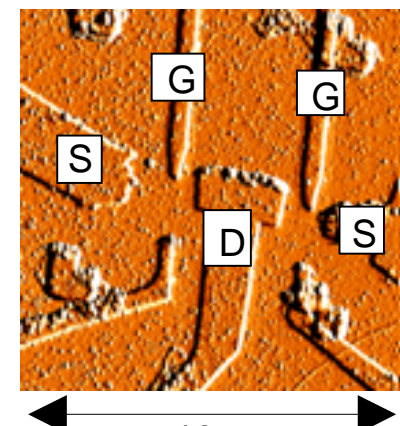
## Salle Blanche ENS Paris



- Surface : 110 m<sup>2</sup>
- Classe : 10 000
- Ouverture : Janv. 2007
- Spécificité : syst. lithographie électronique *e-line*, RAITH  
Platine interférométrique 100×100 mm
- Exemples de réalisations :



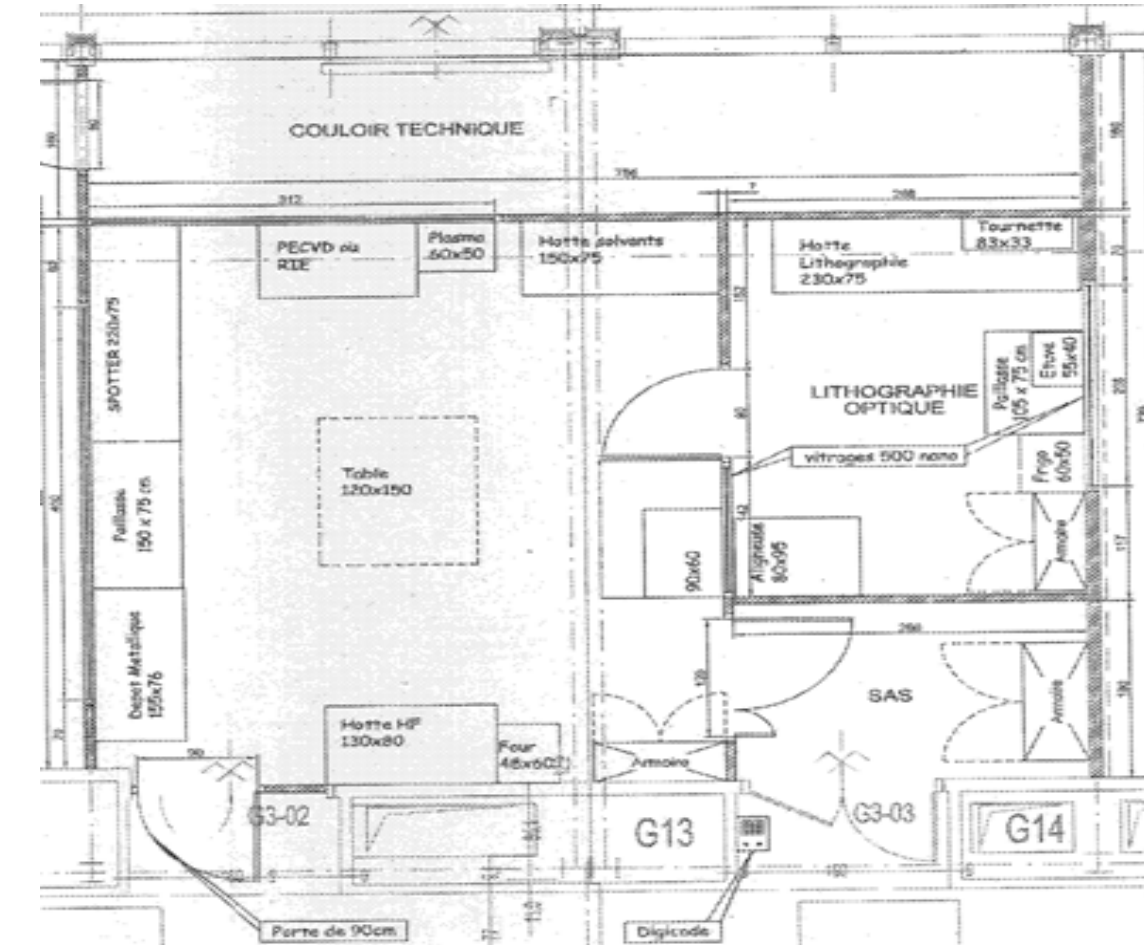
Puce à atomes supraconductrice



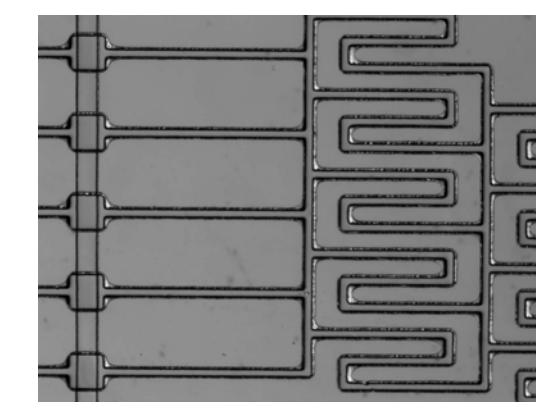
Nanotransistor à effet de champs à double grille à base de nanotube de carbone monoparoi

Contacts : François-René LADAN [ladan@ens.fr](mailto:ladan@ens.fr) ; Michael ROSTICHER [michael.rosticher@ens.fr](mailto:michael.rosticher@ens.fr)

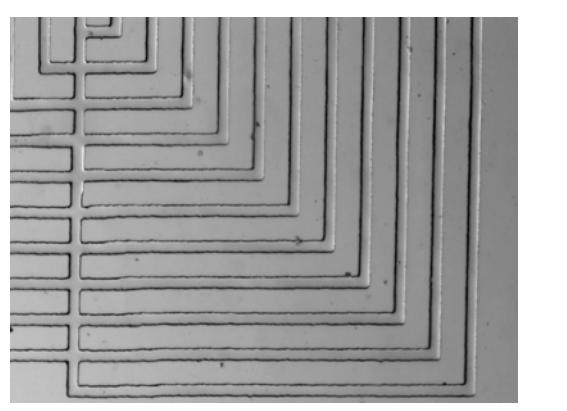
## Salle Blanche ESPCI



- Surface : 40 m<sup>2</sup>
- Classe : 10 000
- Ouverture : Sept. 2006
- Spécificité : élaboration de dispositifs sur matériaux bio-compatibles
- Exemples de réalisations :

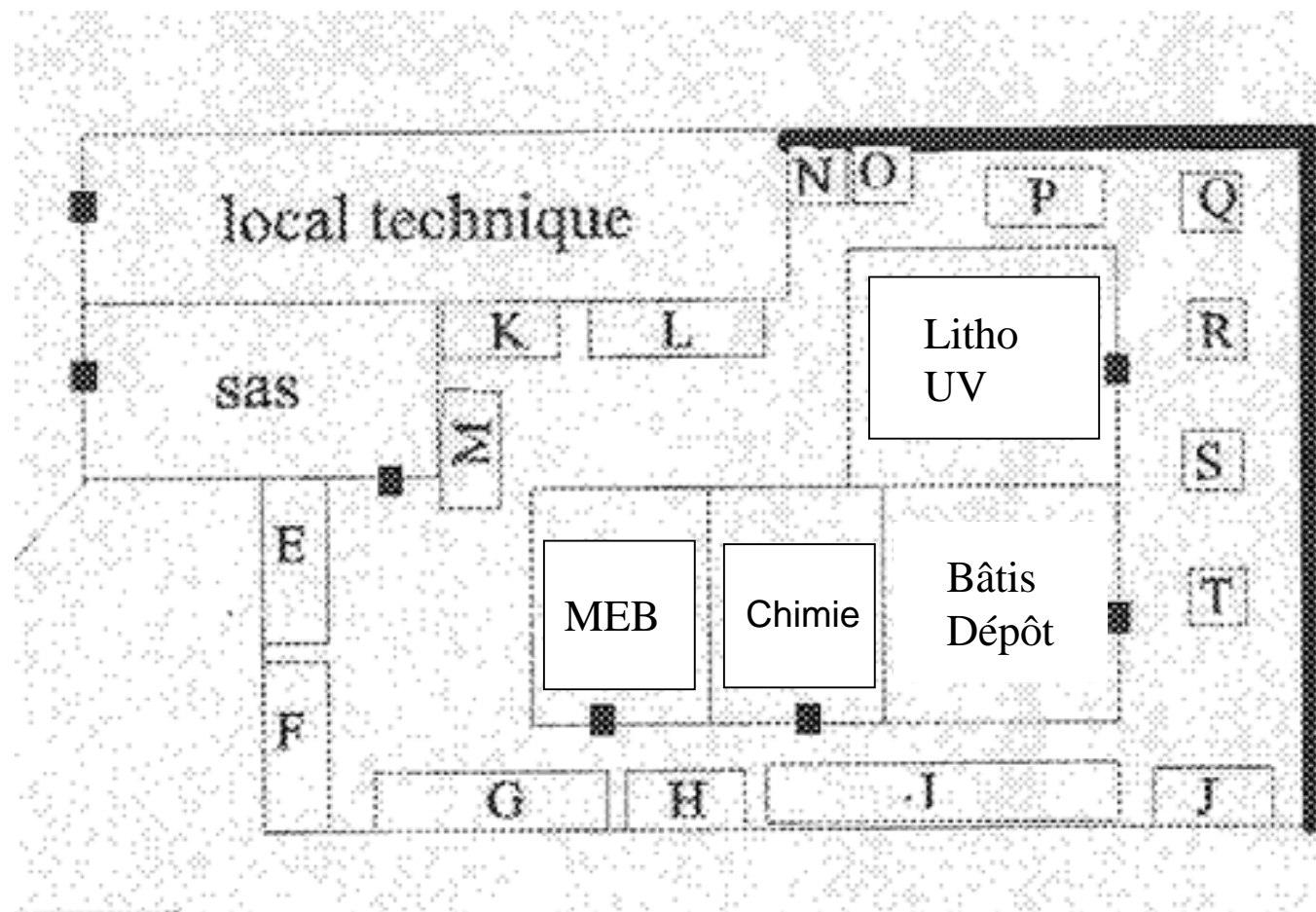


Système de réseau microfluidique sur deux niveaux avec vanne, pour faire des gradients de concentration de produit



Contact : Hervé WILLAIME [hervé.willaime@espci.fr](mailto:hervé.willaime@espci.fr)

## Salle Blanche Univ. Paris VI

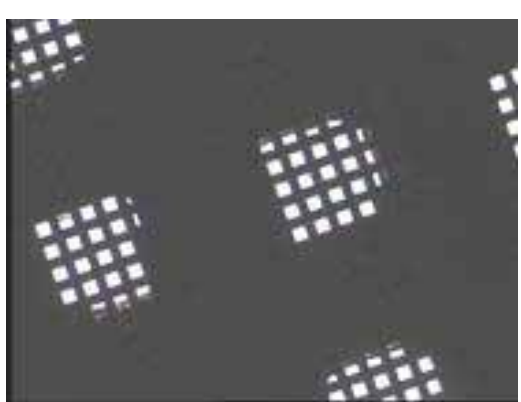


- Surface : 160 m<sup>2</sup>
- Classe : 10 000
- Ouverture : 2008
- Spécificité : Photolithographie UV

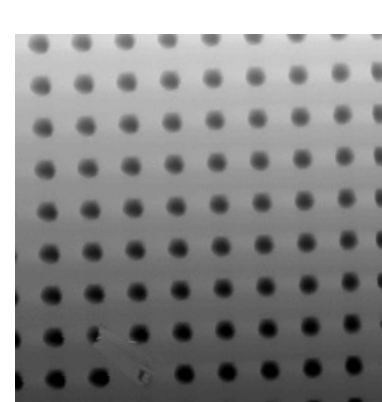


Syst Heidelberg

- Exemples de réalisations :



Membrane Si structurée à une échelle de 100µm



Cristal photonique



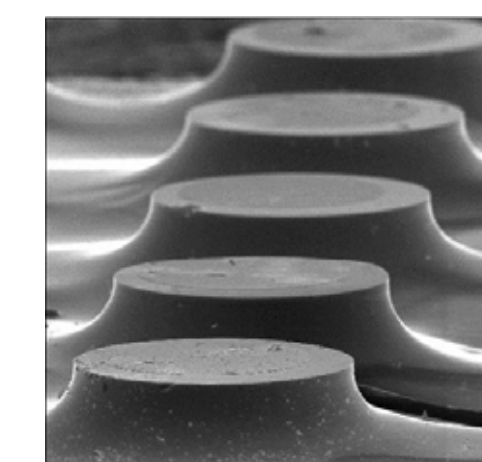
Membrane Si de 2.5µm d'épaisseur

Contact : Bernard BONELLO [bbo@ccr.jussieu.fr](mailto:bbo@ccr.jussieu.fr)

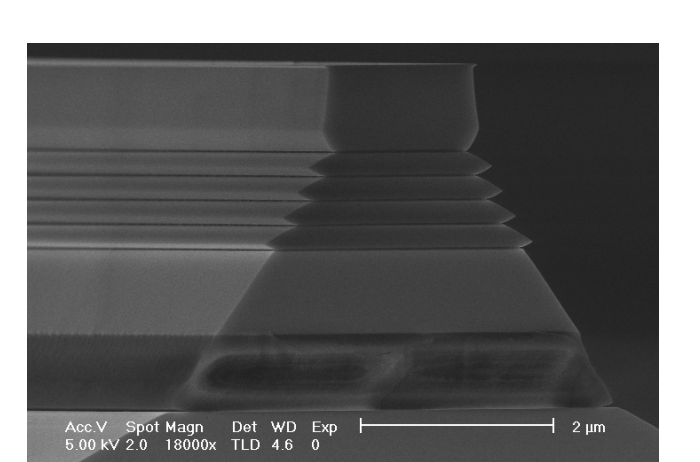
## Salle Blanche Univ. Paris VII



- Surface : 130 m<sup>2</sup>
- Classe : 10 000
- Ouverture : Janv. 2008
- Spécificité : gravure profonde - ICP
- Exemples de réalisations :



Microcavités pour pompage électrique



Guide d'onde en semiconducteur III V pour optique non linéaire

Contacts : Pascal FILLoux [pascal.filloux@thalesgroup.com](mailto:pascal.filloux@thalesgroup.com) ; Christophe MANQUEST [christophe.manquest@paris7.jussieu.fr](mailto:christophe.manquest@paris7.jussieu.fr)

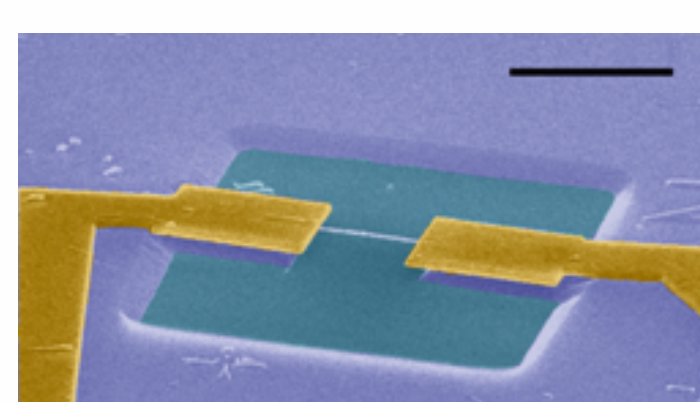
## Atelier de nanofabrication SPEC, CEA-Saclay



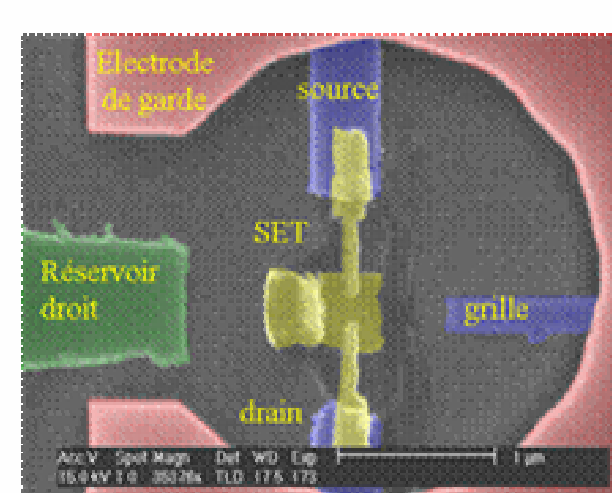
- Salle blanche**  
Surface : 110 m<sup>2</sup>  
Classe : 10 000  
Ouverture : fin 2006



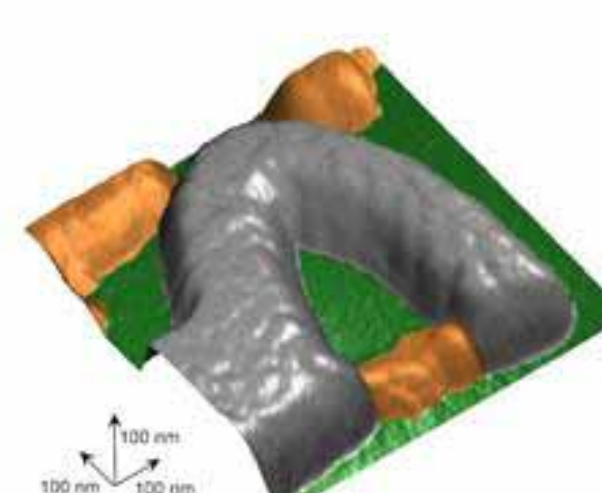
Lithographie UV, E.beam, dépôts de couches minces, gravure ionique réactive  
microscopie électronique, AFM, STM



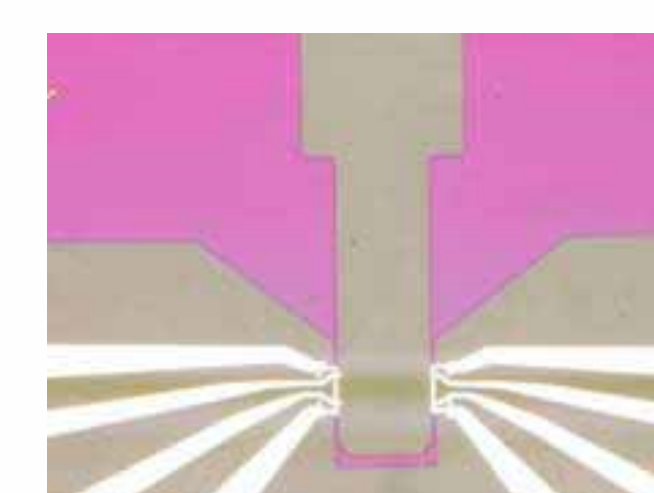
Dispositif électromécanique à base de nanotube de carbone (image MEB)



Piège à électron unique avec son détecteur (image MEB)



Structure hybride normal-supraconducteur (image AFM)



Capteur mixte GMR-supraconducteur pour imagerie médicale (image optique)

Contact : Pierre François ORFILA [orfila@cea.fr](mailto:orfila@cea.fr) ; Cristián Urbina [urbina@cea.fr](mailto:urbina@cea.fr)